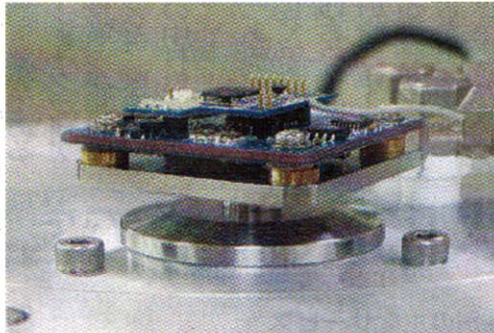


体積半分の真空計

基板・センサー一体に

アズ
コス
・メ
ム
ア



真空反応容器の接続管部分に取り付けたMEMS真空インジケータ

温度変化が異なることを利用した新計測手法を採用。微小電子機械システム(MEMS)技術を活用、シリコン基板とセンサーを最適な形状で一体的に製造した。

新しい真空計は「MEMS真空インジケータ」で半導体製造装置の真空反応容器や食品真空包装機などで真空度が保たれているのかを計測する。大きさは縦四センチ、横四センチ、高さ五センチ。

アズはセンサーと真空反応容器や食品真空包装機などで真空度が保たれているのかを計測する。大きさは縦四センチ、横四センチ、高さ五センチ。

アズはセンサーと真空反応容器や食品真空包装機などで真空度が保たれているのかを計測する。大きさは縦四センチ、横四センチ、高さ五センチ。

半導体関連ベンチャーのメムス・コア(仙台市、本間孝治社長)とアーズ(横浜市、佐藤光社長)は体積が約八立方センチと従来のほぼ半分の真空計を開発、サンプル出荷を始めた。熱したシリコン基板は周囲の真空度で

区別し、この情報を無線で伝送する機能も搭載した。量産時の価格は約二十万円とする既存の真空計よりも安くする計画。従来の真空度は缶の底状のダイヤフラムを使い、真空度の違いによるたわみを計測していた。

アズはセンサーと真空反応容器や食品真空包装機などで真空度が保たれているのかを計測する。大きさは縦四センチ、横四センチ、高さ五センチ。